所望の集光模様を生成するための連続面からなる透明物体の形状設計法

A Design Method of Transparent Objects with Continuous Surfaces for Generating Desired Caustics Patterns

楽 詠灝 † 岩崎 慶 ‡ 陳 炳字 † † 土橋 宜典 ‡ 4 西田 友是 †

Yonghao YUE[†] Kei IWASAKI[‡] Bing-Yu CHEN^{††} Yoshinori DOBASHI^{‡‡} and Tomoyuki NISHITA[†]

††國立臺灣大學 **†**[†] National Taiwan University ↓↓ 北海道大学 ↓↓ Hokkaido University

E-mail: † {yonghao, nis}@nis-lab.is.s.u-tokyo.ac.jp, ‡ iwasaki@sys.wakayama-u.ac.jp

††robin@ntu.edu.tw, ‡‡doba@ime.ist.hokudai.ac.jp

1. はじめに

近年, CG 分野では所望の照明効果を得るための物体の設計 方法に関する研究が盛んに行われている.例えば,目的の反 射フィールド[1],影[2],陰影[3],表面下散乱[4,5],ホログラ ム[6],表面反射[7]などの効果を得る為の方法が開発されてき た.本稿では,日常的に観察できる集光模様(コースティク ス)に着目し,ユーザの入力した所望の集光模様が(画像とし て)与えられたとき,その集光模様を生成する透明物体(一般 に材質はアクリル)の形状を求める,という問題を考える.

具体的には、図1に示すように、透明物体を光源(平行光と 仮定)とスクリーン(平面)の間に置くと、光が屈折してスクリ ーン上に集光模様が形成される状況を実現したい.また、透 明物体は入射面(光が入射する面)を平面と仮定し、射出面(光 が屈折する面)を計算することが目的である.さらに、コンピ ュータによるシミュレーションにとどまることなく、NC機器 による実物の試作も行う.

従来,所望の集光模様を実現する方法として,文献 [8,9,10,11]の方法が開発されてきたが,これらのアプローチ では,生成される射出面あるいは集光模様が連続的ではない ため,集光模様の表現能力に制約を受ける.そこで,本研究 では,射出面が連続面となるような形状設計法を扱う.これ により,表現能力の高い集光模様を実現することをめざす.

表現能力に関する要件は、1)焦点が合った状態で、透明物体 が実現できる集光模様の品質に関する要件と、2) 焦点から外 れた状態で観測できる集光模様に関する要件とを考えること ができ、これらはさらに次の五項目に細分できる.(i)自然画 像などの複雑な集光模様を生成できる,(ii)高解像度な集光模 様を生成できる,(iii)明るい領域だけでなく、暗い領域の表現 能力も高い,(iv)焦点が合う範囲が広い,(v)焦点から外れた場 合でも観測される集光模様が連続的で自然にみえる.(iv)は、 透明物体とスクリーン間の距離や、透明物体の角度の変動に 対して、得られる集光模様の品質が大幅に劣化することを防 ぎ、光源や物体の設置条件等が多少悪くても、所望の集光模 様が生成されるための要件であり,(v)は、我々が日常的に観 察できる連続的な集光模様の印象に合うようにするための要 件である.

2節で述べるように、従来法[8,9,10,11]は、上記(i)から(v)の うち、一つ以上の項目を満足することができない.本研究で は、これらの項目をすべて満足できる透明物体の設計法の開 発が目的である.

2. 関連研究と本研究の位置づけ

従来法[8,9,10,11]は次の二つのアプローチに分類できる. 一つ目は, Finckhらの方法[8]で,射出面にランダムに凹凸を



加えながら変化させ,解となる射出面を探索する方法である. 二つ目は,文献[9,10,11]の方法で,入射面とスクリーンとに 到達する光の間の対応関係を求め,この対応関係に応じて光 が屈折するように,射出面の形状を求める方法である.

一つ目のアプローチでは,解空間は非常に複雑で,多数の 局所解がある.このため,複雑な集光模様を生成する物体形 状を得ること(1節の項目(i))ができない[9].

二つ目のアプローチでは、対応関係を求める方法がキーポ イントである.しかし、従来法ではこの対応関係は離散的で ある.すなわち、従来法では、入射面と射出面はそれぞれ小 領域の集合に分割され、入射面と射出面上の小領域間に対応 関係を確立する.具体的には、Papasらの方法[9]では、入射面 は格子状に、集光模様はガウシアンカーネルの集合に分割さ れ、焼きなまし法で対応関係を求める.楽らの方法[10]では、 入射面と屈折面はファセットに分割され、二部グラフのマッ チングにより対応関係を求める.Yueらの方法[11]では、これ らのファセットが並べ替え可能なアクリル棒で実現される.

これらの方法[9,10,11]では、入射面上の隣り合う小領域に 入射した光は、一般にスクリーン上の離れた(もしくは重なり 合う)小領域に投影される.この不連続性のため、次の問題が 起こる.まず、小領域の大きさに関する制約、もしくは製作 機械の制約(カッターの刃の半径など)のために、各小領域は 一定以上の大きさが必要であり、実現できる集光模様の解像 度(1節の項目(ii))が制限される.次に、集光模様の明るさは基 本的に重なりあう小領域の数で決まり、(各々の小領域の大き さはほぼ同じなので)小領域一つ分以下の明るさを実現でき ない.このため、表現できるダイナミックレンジが制限され る(1節の項目(ii)).さらに、焦点が合う範囲(1節の項目(iv))が 狭く、また、焦点が合わない位置に透明物体をおいた場合、 集光模様が離散的に見える(1節の項目(v)).

本稿では、上述の問題を解決するための透明物体の形状設 計法を提案する.提案法は、上述の二つ目のアプローチに分 類されるが、入射面に到達する光とスクリーンに到達する光 との間に連続的な対応関係を求める点が特徴的である.この 特徴のため、得られる射出面は連続面となり、また射出面か ら射出された光の分布も連続的である.これらの性質により, 上述の問題点をすべて解決できると考えられる.

3. 提案法

提案法の処理は二つのステージから構成される.第一のス テージでは、入射面に到達する光とスクリーンに到達する光 との間の対応関係を求める.第二のステージでは、得られた 対応関係から射出面の形状を計算する.以下順に説明する.

3.1 対応関係の算出法

図2に示すように, 提案法では,平行 光の方向をz軸にと り,入射面をz軸に 五射面上の点は,x, y 座標を用いて表 せる.光は垂直に入 射面に入射するの



で、光は屈折せずに物体内を直進して射出面に到達する.射 出面の各点のz成分は、x、yについての一価関数として表せる. 射出面上で光は屈折し、スクリーン上の点に到達する.入射 面上の点と区別するため、スクリーン上の点のx、y成分はu、v を用いて表す.以下では簡便のため、特に断りがない場合、 入射面上の点とスクリーン上の点を表す場合はz成分を明記 せず、(x,y)や(u,v)のように表す.

光の経路は、入射面上の点p(x,y)とスクリーン上の点q(u,v) との間の対応関係として表せる.提案法では、この対応関係 が1対1対応である場合を考え、集光の度合いを光の密度によ り表現する.すなわち、スクリーン上の各微小領域で所望の 集光模様の輝度分布を表現するためには、入射面上のどの領 域の光を集めてくればよいか、という問題を考える.この問 題は、次に示す二つの条件を満たすような、q(u,v)からp(x,y)~ の写像を求める問題として定式化できる.

一つ目の条件は、この写像が(一部の特異点や特異線分を除いて)全域で連続的であることである.これにより、射出面として連続的なものを得ることができる.二つ目の条件は、この写像が光量の保存を満たすことである.すなわち、入射面上の点の周りの微小な領域dSから輝度Iで入射した光が、スクリーン上の点の周りの微小な領域dS'に輝度I'で到達した場合、 IdS=I'dS'が成立することである.以下、この写像を求める方法を述べる.なお、この写像は解析的に求めることが難しいので、微分幾何学の幾何フローに基づいた方法を用いる.

q(u,v)からp(x,y)への写像は、u,vを用いたx,yのパラメータ化 (parameterization)と考えることができる. すなわち、形式的に はx=f(u,v), y=g(u,v)ように、x,yはu,vの何らかの関数であり、u,vを指定するとx,yが定まる. 提案法では、このパラメータ化を 少しずつ変化させながら、目的の写像に近づけていく. すな わち、まず、x=u, y=v という連続的な初期パラメータ化から 出発する. 次に、第一の条件であるパラメータ化の連続性を 保証したまま、第二の条件である光量の保存がより満たされ るように、このパラメータ化を少しずつ更新していく.

u, *v* によるパラメータ化の下では,光量は次のように定義 できる(図4参照).まず,各点の周りの微小領域の"広がり"は, *x*, *y*の*u*, *v*に関する偏微分から構成されるヤコビアンJとして,

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$
(1)

画電学会年次大会予稿 Proceedings of the IIEEJ Annual Conference



(a)
(b)
(c)
図 3. (a) 差分値 S (赤は正の値,青は負の値を表している). (b)
圧力場 φ. (c) ベクトル場 ∇ φ.

と表すことができる. 集光模 様と初期パラメータ化の組を とると、スクリーン上の各点 における光量は、その点での 集光模様の輝度とヤコビアン をそれぞれCとJとすると、CJ と表せる. また、入射面には 一様光だが、理論上は任意の 分布を扱える)と計算途中の パラメータ化の組をとり、入 射面上の対応点における入射 光の輝度とヤコビアンをLと



図4.光量計算の説明図.

(2)

(4)

*S*とすると,光量は*LP*と表せる.もし,ある写像が任意の点で*CJ=LP*を満たせば,その写像が求めるべき写像である.

計算の途中では、*CJ= LJ*は必ずしも成立しておらず差がある.この差分*S*(図3(a)参照.図3の例では、所望の集光模様は図8(a)で、入射面における入射光の輝度分布は一様とした)を、

$$S = CJ - LJ'$$

と定め、この差分を縮小するように、スクリーン上の点q(u,v)に対応する入射面上の点p(x,y)を連続的に動かして、パラメータ化を更新することを考える.この更新は、光量の差分に対する勾配 ∇S を利用して、 $\partial p/\partial t = \nabla S$ (ここで、tは計算の経過を表す仮想的な時間)として更新することも考えられるが、 ∇S は一般に極めて不連続で勾配が無限大になる場合もあるので、計算を安定的に行うことが難しい.

そこで,提案法では,流体力学の考え方を応用して下記の ように計算する(等積パラメータ表示を求める文献[12]の方法 とも関連する).まず,光量の差分にはプラスの領域とマイナ スの領域があるが,これらをそれぞれ物理的にsourceとsinkと 解釈する.流体力学の考え方を利用すると,このようなsource とsinkを緩和するためには,

$$\nabla^2 \phi = -\nabla S \tag{3}$$

というポアソン方程式を解いて圧力場φ(図3(b)参照)を求め、 φの勾配方向に沿って各点を動かせばよい.すなわち、

$$\partial p/\partial t = \nabla \phi$$

とする. ∇¢(図3(c)参照)は∇Sと異なり, きわめて滑らかなべ クトル場であり, 各点の更新をロバストに扱うことができる. 提案法では, 式(4)に従って, 順次パラメータ表示を更新し ていき, 十分に収束したら計算を打ち切る(図5参照. この例 では7ステップで十分に収束した. またそのときのパラメー タ化(メッシュ表示)の拡大図を図6に示した).

3.2 射出面の計算法

射出面は一価関数として仮定したので、そのz成分は、 z=h(x,y)のように表せる.射出面の法線方向は、 $N = (-\partial h/\partial x, -\partial h/\partial y, 1)$ (5)

と表せる. 従って, x, y成分のみに着目すると,

画像電子学会 The Institute of Image Electronics Engineers of Japan

画電学会年次大会予稿 Proceedings of the IIEEJ Annual Conference



図 5. 対応関係算出の様子. (a) 初期状態, (b)~(e) 1, 3, 5, 7 ステップ経過後.上段:パラメータ化のメッシュ表示(メッシュは細かいため表示が難しいので,各頂点を差分 S に基づいて色付け(グレースケール)を行った).下段:差分表示(赤は正,青は負の値).



図 6. 図 5(e)のパラメータ化のメッシュ表示の拡大図. 集 光模様で輝度が高い部分に相当する領域ではメッシュ間 隔が広い. このため、より広い領域からの光がスクリー ン上に集まり、集光模様の輝度が高くなる.

$$N = -\nabla h$$
 (6)
と表せる. 式(6)の両辺にさらに又を乗算して,
 $\nabla^2 h = -\nabla \cdot N$ (7)

というポアソン方程式を得る(文献[13]の方法と類似).射出面 上の各点での法線がわかると,法線場から式(7)により射出面 を計算できる.なお,法線を計算するには,屈折における入 射角と屈折角および法線の関係を記述したスネルの法則を利 用する.入射光の入射方向は2軸と一致しているので,屈折角 がわかれば,法線を計算できる.スクリーン上の対応点の位 置がわかっているので,屈折角を求めるには,射出面上の位 置(z成分)が必要だが,射出面はまだ求まっていないので,計 算は少し工夫が必要である.提案法では,射出面を平面とし て初期化し,下記二つのステップを反復させて射出面の形状 を更新しながら求める.ステップ1では,屈折角を計算して, 法線を求める.ステップ2では、得られた法線場を元に、式(7) を解いて射出面を更新する.なお、この反復は数ステップで 収束する.

<u>3.3 ディスカッション</u>

提案法で計算された対応関係について補足説明する.提案 法では、射出面上の点p(x,y)とスクリーン上の点q(u,v)との対 応関係を求めたが、その座標の差分(u-x,v-y)をすべて点につ いて考えると、この差分はベクトル場となる.Helmholtz 分解 の考え方によれば、一般にベクトル場は非圧縮成分(勾配が0 の場)と圧縮成分(回転が0の場)の合成で表せる.提案法では、 初期のパラメータ化は回転成分がなく、その後の各ステップ の更新は式(4)に従うが、 $\nabla \times \nabla \phi = 0$ であることから、回転成 分が足されることはない.つまり、提案法で得られる対応関 係には非圧縮成分がない.一方、非圧縮成分のみからなる任 意のベクトル場は、面積を保存するので、提案法で得られる 対応関係に非圧縮成分の対応関係を合成しても、目的の集光 模様を実現できる.この意味で、提案法で得られる対応関係 は、"最小の"対応関係ということができる.

<u>4. 実装</u>

提案法では、三角形メッシュを用いてパラメータ化を表現する. また、光量計算では、各点の"広がり"を表すヤコビアンを計算す る替わりに、メッシュの頂点をノードとするボロノイ図を計算し、 各ボロノイセルの領域内で、対応する輝度分布を積分して光量を もとめる.式(3)および式(7)のポアソン方程式は、これらのメッ シュ上で有限要素法を利用して解く.なお、有限要素法の解法に はFEniCSライブラリ[14]を利用し、区分的に二次の解を求めた.

メッシュ頂点の更新は、式(4)を離散化し、 $p(t_{n+1}) = p(t_n) + \nabla \phi \Delta t$ (ここでnは計算のステップ数)により行う. Δt はすべての三角 形が裏返らないように次のように決定する.まず、各三角形*i* について、その三角形が裏返らないような最大の $\Delta t_i \epsilon x \delta \delta$ (更新前後の三角形の向きが同じであることを調べること で求める).次に、 $\Delta t = \min(A, B \min \Delta t_i)$ によって $\Delta t \epsilon \epsilon \infty$ たする. ここで*A*, *B*は定数であり、本稿ではA=0.95, B=0.5とした.

<u>5. 計算結果</u>

図8(a)に示す集光模様を入力とした場合の計算結果を示す. 入力画像の解像度は 512×512であった.得られた対応関係 (パラメータ化)は図6に示す通りで,この対応関係を元に,計

画像電子学会 The Institute of Image Electronics Engineers of Japan



図 8. 集光模様のシミュレーション結果による比較. (a) 入力の集光模様. (b)~(d) 文献[8,9,10]の方法による結果. (e) 提案法の結果. 画像(b)と(c)は, 文献[9]から転載した.



図 7. 計算された射出面(起伏を 1.5 倍に誇張して表示).



図 9. 射出面とスクリーンとの距離を変化させた場合のシ ミュレーション結果. 左から順に, 焦点距離の 0.5 倍, 1.0 倍, 1.5 倍, 2.0 倍とした場合.

算した射出面を図7に示す(3.2節で述べた反復計算は5回で収 束した). なお、射出面の計算では、物体は100mm角のアクリ ルを想定し、焦点距離は200mmと設定した. このとき、厚み の最も薄いところと厚いところの差は5.2mmであった. この 射出面による集光模様を逆レイトレーシング法でシミュレー ションした結果を図8(e)に示す. 帽子のテクスチャのパター ンや、髪の毛の細かなパターンまで再現できていることがわ かる. また、従来法[8,9,10]のシミュレーション結果を図 8(b),(c),(d)に示す. 従来法と比較して、提案法の方が細部に至 るまで表現できているといえる.

図9に、射出面とスクリーンとの距離を変化させた場合のシ ミュレーション結果を示す. 焦点が合う距離の半分にした場

合や、1.5倍にした場合、集光模様は 多少の変形を伴うが、集光模様のパ ターンが認識できることがわかる. また、距離の変化に伴い、集光模様 は滑らかに変化した.

図10に, NC機械(Roland MODELA シリーズ MDX-40A)を用いて製作 した透明物体により生成された集 光模様を示す. なお,実験段階のた め,製作精度を落としており,集光 模様はぼやけて見える.

6. まとめと今後の課題

本稿では、表現能力の高い集光模様を実現するための形状 設計法を提案した.提案法では、入射面に到達する光とスク リーンに到達する光との間に連続的な対応関係を求めること ができ、連続面から構成される射出面を得ることができる. 対応関係の計算では、微分幾何学の考え方に基づいて、連続 性を保証しながらパラメータ化を更新するアプローチをとっ た.シミュレーションにより,連続的で高品質な集光模様が 生成できることを検証し,手法の有効性を確認した.今後は, 高精度な NC 加工によって実物を製作し,検証したい.

謝辞

本研究は、科研費(研究活動スタート支援 23800011)の助成を うけたものである.

参考文献

- [1] M. Fuchs, R. Raskar, H.-P. Seidel, H.P.A. Lensch, "Towards passive 6D reflectance field displays," ACM Transactions on Graphics (Proc. of SIGGRAPH 2008) Vol. 27, No. 3, pp.58:1–58:8 (2008).
- [2] N.J. Mitra, M. Pauly, "Shadow art," ACM Transactions on Graphics (Proc. of SIGGRAPH Asia 2009) Vol.28, No.5, pp.156:1–156:7 (2009).
- [3] M. Alexa, W. Matusik, "Reliefs as images," ACM Transactions on Graphics (Proc. of SIGGRAPH 2010) Vol. 29, No. 4, pp. 60:1–60:7, (2010).
- [4] Y. Dong, J. Wang, F. Pellacini, X. Tong, B. Guo, "Fabricating spatially-varying subsurface scattering," ACM Transactions on Graphics (Proc. of SIGGRAPH 2010) Vol. 29, No. 4, pp. 62:1–62:10 (2010).
- [5] M. Hašan, M. Fuchs, W. Matusik, H. Pfister, S. Rusinkiewicz, "Physical reproduction of materials with specified subsurface scattering," ACM Transactions on Graphics (Proc. of SIGGRAPH 2010) Vol. 29, No. 4, pp.61:1–61:10 (2010).
- [6] C. Regg, S. Rusinkiewicz, W. Matusik, M. Gross, "Computational highlight holography," ACM Transaction on Graphics (Proc. of SIGGRAPH Asia 2010) Vol. 29, No. 6, pp. 170:1–170:12 (2010).
- [7] T. Weyrich, P. Peers, W. Matusik, S. Rusinkiewicz, "Fabricating microgeometry for custom surface reflectance," ACM Transactions on Graphics (Proc. of SIGGRAPH 2009) Vol. 28, No. 3, pp. 32:1–32:6 (2009).
- [8] M. Finckh, H. Dammertz, H. Lensch, "Geometry construction from caustic images," Proc. of ECCV 2010, pp. 464-477 (2010).
- [9] M. Papas, W. Jarosz, W. Jakob, S. Rusinkiewicz, W. Matusik, T. Weyrich, "Goal-based Caustics," Computer Graphics Forum (Proc. of EUROGRAPHICS 2011) Vol. 30, No. 2, pp.503-511 (2011).
- [10] 楽, 岩崎, 陳, 土橋, 西田, "所望の集光模様を生成する透明物体の一 設計法," Visual Computing / グラフィクスと CAD 合同シンポジウム 2011, 発表番号 2 (2011).
- [11] Y. Yue, K. Iwasaki, B.-Y. Chen, Y. Dobashi, T. Nishita, "Pixel Art with Refracted Light by Rearrangeable Sticks," Computer Graphics Forum (Proc. of EUROGRAPHICS 2012) Vol.31, No.2, pp.575-582 (2012).
- [12] G. Zou, J. Hu, X. Gu, J. Hua, "Authalic Parameterization of General Surfaces Using Lie Advection," IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol.17, Bo.12, pp. 2005-2014 (2011).
- [13] Y. Yu, K. Zhou, D. Xu, X. Shi, H. Bao, B, Guo, H.-Y. Shum, "Mesh Editing with Poisson-based Gradient Field Manipulation," ACM Transactions on Graphics (Proc. of SIGGRAPH 2004) Vol.23, No.3, pp. 644-651 (2004).
- [14] A, Logg, K.-A. Mardal, G. Wells, "Automated Solution of Differential Equations by the Finite Element Method – The FeniCS Book," Springer Lecture Notes in Computational Science and Engineering, Vol.84 (2012).



図 10. NC 機械によ り作製した透明物体 (左)と、その集光模 様(右).